

ICS 31.200
L 55



中华人民共和国国家标准

GB/T 26111—2010

GB/T 26111—2010

微机电系统(MEMS)技术 术语

Micro-electromechanical system technology—Terms

中华人民共和国
国家标准
微机电系统(MEMS)技术 术语
GB/T 26111—2010

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 2.5 字数 62 千字
2011年2月第一版 2011年2月第一次印刷

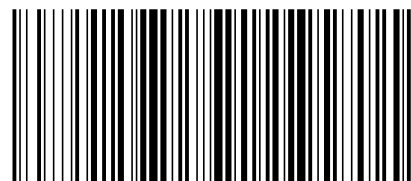
*

书号: 155066·1-41568 定价 36.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 26111—2010

2011-01-10 发布

2011-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

S

sacrificial etching 3.5.15

sacrificial layer 3.7.25

scale effect 3.2.1

scanning electron microscope 3.7.10

scanning micromirror 3.8.50

scanning probe microscope 3.7.6

scanning tunneling microscope 3.7.8

scanning tunneling microscope machining 3.5.32

shape memory alloy 3.3.4

shape memory alloy actuation 3.2.13

shape memory alloy microactuator 3.8.33

silicon carbide 3.3.12

silicon dioxide 3.3.10

silicon efficiency 3.6.32

silicon fusion bonding 3.5.38

silicon nitride 3.3.11

silicon process 3.5.2

sintering 3.6.33

sol-gel conversion microactuator 3.8.34

sonic microsensors 3.8.18

sound wave actuation 3.2.12

static analysis 3.4.19

stereomicroscope 3.7.3

stiction 3.2.3

structural layer 3.7.22

support region 3.7.23

surface effect 3.2.2

surface micromachining 3.5.10

surface profilometer 3.7.12

surface tension 3.2.14

T

TAB 3.6.14

tactile microsensors 3.8.17

tape automated bonding 3.6.14

test on chip 3.7.17

test out-of-chip 3.7.18

test structure 3.7.19

tissue chip 3.8.56

tool microscope 3.7.5

top-down design 3.4.5

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

 3.1 综合性术语 1

 3.2 科学与工程术语 2

 3.3 与材料相关的术语 3

 3.4 与设计相关的术语 4

 3.5 与加工工艺相关的术语 7

 3.6 封装与组装术语 10

 3.7 测量技术术语 13

 3.8 与器件相关的术语 15

参考文献 22

索引 23

汉语拼音索引 23

英文对应词索引 27

micro-electromechanical system technologies	3. 1. 2
micro resonator	3. 8. 36
microaccelerometer	3. 8. 14
microactuator	3. 8. 24
microassembling	3. 6. 9
microbearing	3. 8. 44
microcantilever	3. 8. 46
microchannel	3. 8. 48
microelectrode array	3. 8. 52
microelectrode	3. 8. 51
micro-electrodischarge machining	3. 5. 29
micro-electromechanical systems	3. 1. 1
microflow sensor	3. 8. 19
micro-fuel cell	3. 8. 53
microgear	3. 8. 43
microgripper	3. 8. 42
microgyroscope	3. 8. 16
micromachine	3. 1. 1
micromachining	3. 5. 1
micromanipulator	3. 6. 11
micromirror	3. 8. 49
micromotor	3. 8. 27
micro-mould design	3. 4. 8
micromoulding	3. 5. 28
micro-optical-electronicmechanical systems	3. 1. 6
micropump	3. 8. 40
micro-science and engineering	3. 1. 3
microsensor	3. 8. 2
microspring	3. 8. 45
microswitch	3. 8. 37
microsystem	3. 1. 1
microvalve	3. 8. 41
modal analysis	3. 4. 20
MOEMS	3. 1. 6
monocrystalline silicon	3. 3. 5
multichip package	3. 6. 3
multiscale model	3. 4. 24
N	
N type silicon	3. 3. 8
nano indenter	3. 7. 13
near-field microscope	3. 7. 9
noise	3. 4. 16

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国微机电技术标准化技术委员会(SAC/TC 336)提出并归口。

本标准主要起草单位：中机生产力促进中心、中国电子科技集团第 13 研究所、清华大学、上海交通大学、中北大学。

本标准主要起草人：丁红宇、刘伟、张苹、崔波、杨拥军、叶雄英、陈迪、石云波。